

누설 방지 폐쇄 환류 기술 및 맞춤형 다위치 용량을 갖춘 고순도 Ptfе 산증기 세정 시스템 미량분석 실험기기 오염제거 유닛

품목 번호: PL-CP113



소개

이 고순도 PTFE 산증기 세정 시스템으로 미량분석 워크플로우를 최적화하세요. 상당한 산 절약과 우수한 오염제거를 위한 누설 방지 폐쇄 루프 디자인을 특징으로 하는 이 맞춤형 유닛은 민감한 ICP-MS 및 ICP-OES 실험실 응용 분야에서 초저 배경 수준을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
미량 금속 분석	ICP-MS 및 ICP-OES 샘플 전처리에 사용되는 TFM 및 PFA 분해 용기의 오염 제거	PPT 및 PPB 검출을 위한 초저 배경 수준 달성
반도체 제조	표면 미량 오염물질을 제거하기 위한 PFA 웨이퍼 캐리어 및 유체 처리 부품 세정	고순도 제조 공정에서 금속 오염 방지
지구화학 연구	광물 용해 및 동위원소 분석에 사용되는 테플론 도가니와 분해 튜브의 심층 세정	민감한 동위원소 및 광물학 측정에서 높은 정확도 보장
환경 모니터링	중금속 검사 전에 토양 및 수질 샘플 용기 대량의 자동 세척	엄격한 품질 관리를 유지하면서 실험실 처리량 증가
임상 및 제약	민감한 생물학 및 약물 대사 연구에 사용되는 PFA 바이알과 피펫의 살균	민감한 의료 샘플 배치 간 교차오염 제거
원자력 공학	방사성 및 부식성 물질 분석에 사용되는 특수 불소중합체 실험기기의 오염 제거	유해 시약을 다루기 위한 안전한 밀폐 환경 제공

매개변수	PL-CP113의 사양
제품 품목 번호	PL-CP113
주요 구조 재료	고순도 버진 PTFE / PFA
세정 메커니즘	산증기 환류 / 서브-비등 증기 세정
호환 시약	HNO3, HCl, HF 및 기타 고순도 산
처리 용량	26개 위치(표준) / 완전 맞춤 설정 가능
밀봉 방식	나사식 및 가스켓 누설 방지 밀봉
내온도성	재료 제한으로 최대 200°C까지 연속 작동
맞춤 설정 옵션	챔버 치수, 액 형상 및 튜브 직경
제어 시스템	외부 PID 온도 컨트롤러와 호환
제조 공정	엔드투엔드 정밀 CNC 제작